

MarSurf XC 20

Новое поколение систем измерения контура

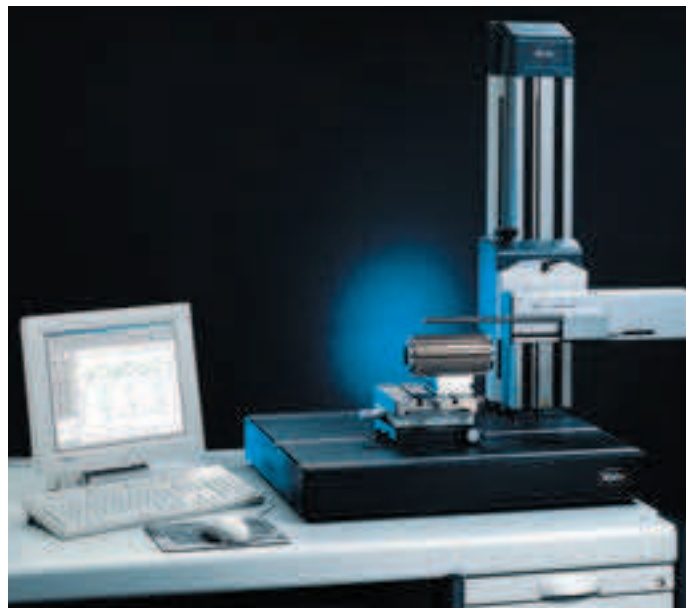
Описание

Когда дело доходит до измерения контура, прибор **MarSurf XC 20** является наилучшим выбором. То, что более 30 лет назад называлось контурографом, состоящим из механизма подачи и двухкоординатного плоттера, сегодня превратилось в суперсовременную систему измерения контура с новейшими технологиями. Эта полностью согласованная конфигурация приборов соответствует высочайшим стандартам качества работы. Механизм подачи и измерительный стенд управляются и позиционируются с помощью достоверных измерений и аналитического программного обеспечения.

Особенности

В дополнение к функциям прибора первого уровня **MarSurf XC 2**, прибор **MarSurf XC 20** обеспечивает дополнительные функции:

- Возможно отображение примечаний в процессе работы
 - Интерактивные элементы управления поддерживают процесс обработки и автоматическую последовательность операций
 - Измерение верхнего и нижнего контура "двухпорным щупом"; эти контуры могут быть обработаны друг относительно друга
 - Образование участков профилей с вычислением различных параметров каждого участка
 - Возможны сегментированные измерения вокруг неоднородностей, таких как отверстия или острые кромки
 - Импорт файлов формата DXF для сравнения заданных/фактических значений
 - Механизм подачи PCV 200 с запатентованным фиксатором щуповой консоли позволяет производить воспроизводимую смену щуповых консолей без использования инструмента
 - Гибкость измерительной станции благодаря патентованной системе щупов
 - Свободно варьируемое вручную усилие ощупывания также обеспечивает гибкость системы
 - Синтетическое составление заданных профилей из прямых и дуг окружностей
 - Простая процедура сравнения заданных и текущих профилей
- Внутри измеренного профиля может быть установлено несколько диапазонов и каждый из этих диапазонов может быть поставлен в соответствие различным допускам и отдельно обработан



Исполнение

Комбинированием программного обеспечения **MarSurf XC 20**, высокоточной системы **UD 120**, оснащенной щупом и приводом, и измерительной стойки **ST 500** или **ST 750** может быть достигнута разрешающая способность в нанометровом диапазоне, и появится возможность определять контур и глубину микронеровностей за один цикл измерений.

Дополнительные функции, такие как экспорт данных в формате **QS-STAT** или определение доминантной волнистости, поставляются по заказу.



WebCode 2736

